

证书号第7922209号





去利小生信息

发明专利证书

发明名称:一种图像曝光度的无监督自动化校正方法

专 利 权 人: 同济大学

地 址: 200092 上海市杨浦区四平路1239号

发明人: 张林:张荔郡;朱安琪;刘潇;沈莹

专 利 号: ZL 2019 1 0157657.1 授权公告号: CN 111640068 B

专利申请日: 2019年03月01日 授权公告日: 2025年05月06日

申请日时申请人: 同济大学

申请日时发明人: 张林:张荔郡;朱安琪;刘潇;沈莹

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查,决定授予专利权,并予以公告。 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长 申长雨 中公和



第1页(共1页)

